



微系统工程系

- ▶ 两院院士
- ▶ 长江学者
- ▶ 杰出青年基金
- ▶ 千人计划
- ▶ 国家名师
- ▶ 优秀人才
- ▶ 师资队伍
- ▶ 资源下载

◆ 当前位置: [首页](#)>>[师资队伍](#)>>[师资队伍](#)>>[副教授 \(高级工程师\)](#)>>[微系统工程系](#)>>正文

何 洋

2012-04-28 14:38

基本信息				
姓名	何洋	出生年月	1979.6	
学历/学位	研究生/博士			
专业技术职务	副教授			
联系电话	88460353-8112			
E-mail	heyang@nwpu.edu.cn			
主要研究方向及内容				
主要从事微纳结构制备与应用方面研究。2007年11月至2008年11月在香港理工大学开展合作研究。西北工业大学“机械电子工程”国家重点学科“新人新事新方向”建设项目“仿生微纳结构可控制备及应用”方向负责人。主持国家自然科学基金1项，陕西省自然科学基金基础研究计划项目1项，航空科学基金1项，西北工业大学基础研究基金2项，参与863重大研究计划等国家级科研项目多项。				
公开发表论文（代表作）				
1. He Yang, Jiang Chengyu, Yin Hengxu, Chen Jun, Yuan Weizheng. Superhydrophobic silicon surfaces with micro-nano hierarchical structures via deep reactive ion etching and galvanic etching. Journal of Colloid and Interface Science, 2011, 364, 219-229. (IF:3.068, SCI: 000296038600029)				
2. He Yang, Jiang Chengyu, Yin Hengxu, Yuan Weizheng. Tailoring the wettability of patterned silicon surfaces with dual-scale pillars: From hydrophilicity to superhydrophobicity. Applied Surface Science, 2011, 257: 7689 - 7692. (IF:1.795 , SCI: 000290790900054)				
3. He Yang, Jiang Chengyu, Liu Zhenya, Ren Sen, Chen jun, Yuan Weizheng. Improve blood clotting feature of silicon microneedle by silver coating. Key Engineering Materials, 2011, 483: 255-258. (EI: 20113114190310)				
4. He Yang, Jiang Chengyu, Yin Hengxu, Chenjun, Yuan Weizheng. Effect of wet etching parameter on the diameter and length of silicon nanowires . Key Engineering Materials, 2011, 483: 584-588. (EI: 20113114190373)				
5. He Yang, Jiang Chengyu, Yung Kai-Leong, Xu Yan, Yuan Weizheng. Rapidly identify the critical parameter of MEMS device based on element model library. Key Engineering Materials, 2011, 483: 684-689. (EI: 20113114190392)				
获奖情况、荣誉称号、社会兼职等				
先后获得陕西省科学技术一等奖1项、中国机械工业科学技术一等奖1项、国防科学技术二等奖2项。发表论文被SCI/EI检索十余篇。申请国家发明专利十余项，获得授权国家发明专利3项，实用新型专利2项，软件著作权登记权1项。指导学生参加中国微传感器应用大赛获得国际二等奖、全国特等奖等大奖20余项，学生获奖层次和数量在全国高校名列前茅，被评为全国最佳指导教师，并获得特别贡献奖。获得陕西省教学成果特等奖1项。先后获得西北工业大学“翱翔之星”、“机电精英”等荣誉称号。				

